



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113967963 A

(43) 申请公布日 2022. 01. 25

(21) 申请号 202111413733.4

(22) 申请日 2021.11.25

(71) 申请人 义乌市富格机械有限公司
地址 322099 浙江省金华市义乌市稠江街
道稠州西路239号

(72) 发明人 王洪

(51) Int. Cl.

B28B 11/04 (2006.01)

B24B 27/033 (2006.01)

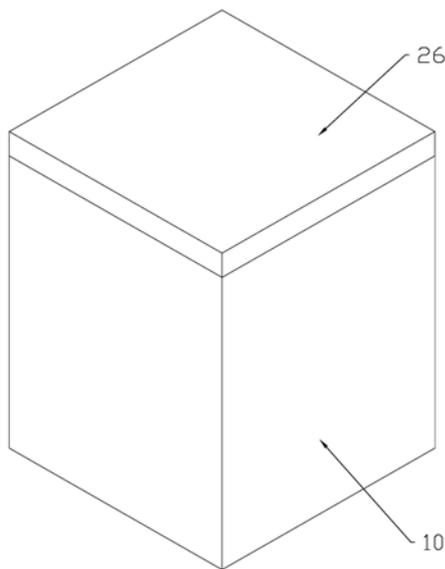
权利要求书2页 说明书5页 附图5页

(54) 发明名称

一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备

(57) 摘要

本发明属于陶瓷制作领域,尤其是涉及一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,该陶瓷杯上釉的工艺采用如下陶瓷杯上釉的设备配合完成,该陶瓷杯上釉的设备,包括外壳,外壳内设有一侧开口的上釉腔,上釉腔远离开口的内壁上转动设有转盘,转盘内设有一开口朝向上釉腔的收纳槽,收纳槽内靠近上釉腔侧设有上釉机构,上釉腔内远离上釉腔侧设有离合动力机构,外壳内位于上釉腔的外围设有磨底固定机构,外壳内远离上釉腔侧设有离合触发机构,通过喷射水雾可以更好的陶瓷杯吸收水分,且不会产生滑动的水珠,喷釉可以更好的陶瓷杯表面挂釉,使釉面不容易被烤裂,且还可以防止产生滑动的釉珠。



1. 一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,其特征在于:该陶瓷杯上釉的工艺采用一种陶瓷杯上釉的设备配合完成,该陶瓷杯上釉的设备,包括外壳(10),所述外壳(10)内设有一侧开口的上釉腔(37),所述上釉腔(37)远离所述开口的内壁上转动设有转盘(17),所述转盘(17)内设有开口朝向所述上釉腔(37)的收纳槽(19),所述收纳槽(19)内靠近所述上釉腔(37)侧设有上釉机构(91),所述上釉腔(37)内远离所述上釉腔(37)侧设有离合动力机构(93),所述外壳(10)内位于所述上釉腔(37)的外围设有磨底固定机构(90),所述外壳(10)内远离所述上釉腔(37)侧设有离合触发机构(92)。

2. 根据权利要求1所述的一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,其特征在于:所述磨底固定机构(90)包括所述外壳(10)内环形均匀设有的四个开口朝向所述上釉腔(37)开口方向的收缩槽(15),每个所述收缩槽(15)内都滑动设有电磁支撑杆(16),每个所述电磁支撑杆(16)靠近所述上釉腔(37)开口端共同固定设有一个顶板(26),所述顶板(26)靠近所述上釉腔(37)侧的中心位置固定设有凸台(39),所述凸台(39)上转动设有转盘(40),所述转盘(40)远离所述顶板(26)端固定设有打磨纸(41),所述凸台(39)内靠近所述转盘(40)内圈的一侧设有开口朝向转盘(40)的转动腔(44),所述转动腔(44)的内壁上嵌设有打磨电机(42),所述打磨电机(42)的自带轴上固定设有打磨齿轮(43),所述打磨齿轮(43)与所述转动腔(44)内圈内核连接。

3. 根据权利要求2所述的一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,其特征在于:所述离合触发机构(92)包括所述外壳(10)远离所述顶板(26)侧的中心位置设有的离合滑槽(21),所述离合滑槽(21)内滑动设有离合板(38),所述外壳(10)位于所述离合滑槽(21)处绕所述离合滑槽(21)对应所述四个收缩槽(15)设有四个转杆槽(11),每个所述收缩槽(15)的内壁上都设有开口朝向收缩槽(15)的滑槽(12),每个所述滑槽(12)内都滑动设有机关槽(54),每个所述机关槽(54)通过机关开关弹簧(13)连接在所述滑槽(12)的内壁上,每个所述滑槽(12)靠近所述对应转杆槽(11)侧都连通所述转杆槽(11),每个所述机关槽(54)都通过可转动的转杆(14)铰接在所述离合板(38)上,每个所述转杆(14)靠近所述离合滑槽(21)侧都通过铰链连接在对应转杆槽(11)的侧壁上。

4. 根据权利要求3所述的一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,其特征在于:所述上釉机构(91)包括所述收纳槽(19)远离所述上釉腔(37)的内壁上转动设有丝杆(32),所述丝杆(32)上靠近所述收纳槽(19)的开口处螺纹设有支撑板(31),所述支撑板(31)上设有通气孔,所述支撑板(31)上的中心位置固定设有支撑柱(29),所述支撑板(31)关于所述支撑柱(29)两侧对称固定设有两个外喷釉杆(23),所述收纳槽(19)的内壁上远离所述丝杆(32)的固定设有釉料箱(20),所述收纳槽(19)的内壁上靠近所述丝杆(32)处固定设有两个水箱(51)。

5. 根据权利要求4所述的一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,其特征在于:所述上釉机构(91)还包括所述支撑柱(29)靠近所述顶板(26)端固定设有的内喷嘴(27),两个所述外喷釉杆(23)靠近所述顶板(26)端都朝向内喷嘴(27)固定设有的外喷嘴(24),远离所述丝杆(32)的所述外喷嘴(24)通过外釉管(25)穿过所述外喷釉杆(23)连接到釉料箱(20)内,所述内喷嘴(27)通过内釉管(28)穿过所述支撑柱(29)连接在釉料箱(20)内,靠近所述丝杆(32)的外喷嘴(24)与所述内喷嘴(27)通过水管(33)分别穿过所述外喷釉杆(23)与所述支撑柱(29)连接在所述水箱(51)内,所述水箱(51)内远离所述丝杆(32)侧滑动设有推水板(52),所述推水板(52)通过水板弹簧(53)连接在所述水箱(51)远离所述丝杆(32)的侧壁上,每个所述

釉料箱(20)靠近所述水箱(51)侧都滑动设有推釉板(49),每个所述推釉板(49)都通过釉板弹簧(50)连接在对应所述釉料箱(20)靠近所述水箱(51)的侧壁上,所述水管(33)与所述内喷嘴(27)的连接处与所述水管(33)与所述外喷嘴(24)的连接处固定设有第一电磁阀(55),所述内釉管(28)与内喷嘴(27)的连接处与所述外釉管(25)与外喷嘴(24)的连接处固定设有第二电磁阀(56)。

6.根据权利要求5所述的一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,其特征在于:所述离合动力机构(93)包括所述转盘(17)内靠近所述离合滑槽(21)侧设有的离合腔(34),所述离合腔(34)靠近所述收纳槽(19)侧设有用于出风的通孔,所述离合腔(34)靠近所述离合滑槽(21)的侧壁上嵌设有离合电机(35),所述离合电机(35)的自带轴固定设有主动齿轮(47)与风扇(48),所述风扇(48)相较于所述主动齿轮(47)靠近所述收纳槽(19),所述离合板(38)靠近所述丝杆(32)侧转动设有离合轴(36),所述离合轴(36)贯穿所述离合滑槽(21)伸到所述离合腔(34)内,所述离合腔(34)位于所述离合腔(34)端固定设有离合齿轮(46),所述丝杆(32)位于所述离合腔(34)端固定设有从动齿轮(45),所述离合齿轮(46)同时啮合所述从动齿轮(45)与所述主动齿轮(47),所述离合腔(34)关于所述离合电机(35)对称的两侧内壁上设有通气腔(18),所述外壳(10)内位于所述通气腔(18)开口处设有环形的风腔(22),所述风腔(22)靠近所述上釉腔(37)侧设有通风孔。

7.根据权利要求1-6所述的一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,其特征在于:

采用该陶瓷杯上釉的设备对陶瓷杯上釉的工艺包括以下步骤:

S1:固顶瓷杯,将瓷杯底部通过凸台(39)粘接在凸台(39)上,使杯口朝向内喷嘴(27);

S2:浸水,在瓷杯朝内喷嘴(27)运动时靠近丝杆(32)的外喷嘴(24)与内喷嘴(27)向瓷杯的内外侧喷射水雾,使瓷杯浸水;

S3:喷釉,通过远离丝杆(32)的外喷嘴(24)与内喷嘴(27)向瓷杯的内外侧喷射釉料;

S4:风干,通过风扇(48)产生的风对瓷杯上的釉料风干冷却;

S5:清洗复位,支撑板(31)复位时通过水管(33)对外喷嘴(24)与内喷嘴(27)进行清洗;

S6:磨底,通过打磨纸(41)对瓷杯底部边缘的釉渣进行轻打磨。

一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备

技术领域

[0001] 本发明属于陶瓷制作领域,尤其是涉及一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备。

背景技术

[0002] 陶瓷是陶器与瓷器的总称,瓷杯,从古至今其主要功能都是用来饮酒或饮茶,为了美观与结实,通常会在瓷器上上釉烧制,目前人们将制作好的瓷杯在上釉时,通常都是一只手拿着坯料,将瓷杯浸入釉桶内,进行上釉,目前这种上釉工艺存在以下问题:

[0003] ①在上釉过程中会造成瓷杯上釉不均匀,且在瓷杯拿出上釉桶时会形成滑珠;

[0004] ②现有的自动上釉设备在上釉时,瓷杯被夹持部分会缺釉,需要再次夹持才能完全将瓷杯外侧上釉;

[0005] ③手工上釉时陶瓷杯底容易沾到釉水,上完釉后需要对陶瓷杯底进行擦拭,过程繁琐。

发明内容

[0006] 本发明的目的是针对现有技术中存在的上述问题,提出了一种可以防止杯壁滑釉,且可以将瓷杯底的釉料打磨干净的陶瓷杯上釉的工艺及其设备。

[0007] 为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0008] 一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,该陶瓷杯上釉的工艺采用如下陶瓷杯上釉的设备配合完成,该陶瓷杯上釉的设备,包括外壳,所述外壳内设有一侧开口的上釉腔,所述上釉腔远离所述开口的内壁上转动设有转盘,,所述转盘内设有开口朝向所述上釉腔的收纳槽,所述收纳槽内靠近所述上釉腔侧设有上釉机构,所述上釉腔内远离所述上釉腔侧设有离合动力机构,所述外壳内位于所述上釉腔的外围设有磨底固定机构,所述外壳内远离所述上釉腔侧设有离合触发机构。

[0009] 优选的,所述磨底固定机构包括所述外壳内环形均匀设有的四个开口朝向所述上釉腔开口方向的收缩槽,每个所述收缩槽内都滑动设有电磁支撑杆,每个所述电磁支撑杆靠近所述上釉腔开口端共同固定设有一个顶板,所述顶板靠近所述上釉腔侧的中心位置固定设有凸台,所述凸台上转动设有转盘,所述转盘远离所述顶板端固定设有打磨纸,所述凸台内靠近所述转盘内圈的一侧设有开口朝向转盘的转动腔,所述转动腔的内壁上嵌设有打磨电机,所述打磨电机的自带轴上固定设有打磨齿轮,所述打磨齿轮与所述转动腔内圈内核连接。

[0010] 优选的,所述离合触发机构包括所述外壳远离所述顶板侧的中心位置设有的离合滑槽,所述离合滑槽内滑动设有离合板,所述外壳位于所述离合滑槽处绕所述离合滑槽对应所述四个收缩槽设有四个转杆槽,每个所述收缩槽的内壁上都设有开口朝向收缩槽的滑槽,每个所述滑槽内都滑动设有机关槽,每个所述机关槽通过机关开关弹簧连接在所述滑槽的内壁上,每个所述滑槽靠近所述对应转杆槽侧都连通所述转杆槽,每个所述机关槽都通过可转动的转杆铰接在所述离合板上,每个所述转杆靠近所述离合滑槽侧都通过铰链连

接在对应转杆槽的侧壁上。

[0011] 优选的,所述上釉机构包括所述收纳槽远离所述上釉腔的内壁上转动设有丝杆,所述丝杆上靠近所述收纳槽的开口处螺纹设有支撑板,所述支撑板上设有通气孔,所述支撑板上的中心位置固定设有支撑柱,所述支撑板关于所述支撑柱两侧对称固定设有两个外喷釉杆,所述收纳槽的内壁上远离所述丝杆的固定设有釉料箱,所述收纳槽的内壁上靠近所述丝杆处固定设有两个水箱。

[0012] 优选的,所述上釉机构还包括所述支撑柱靠近所述顶板端固定设有的内喷嘴,两个所述外喷釉杆靠近所述顶板端都朝向内喷嘴固定设有的外喷嘴,远离所述丝杆的所述外喷嘴通过外釉管穿过所述外喷釉杆连接到釉料箱内,所述内喷嘴通过内釉管穿过所述支撑柱连接在釉料箱内,靠近所述丝杆的外喷嘴与所述内喷嘴通过水管分别穿过所述外喷釉杆与所述支撑柱连接在所述水箱内,所述水箱内远离所述丝杆侧滑动设有推水板,所述推水板通过水板弹簧连接在所述水箱远离所述丝杆的侧壁上,每个所述釉料箱靠近所述水箱侧都滑动设有推釉板,每个所述推釉板都通过釉板弹簧连接在对应所述釉料箱靠近所述水箱的侧壁上,所述水管与所述内喷嘴的连接处与所述水管与所述外喷嘴的连接处固定设有第一电磁阀,所述内釉管与内喷嘴的连接处与所述外釉管与外喷嘴的连接处固定设有第二电磁阀。

[0013] 优选的,所述离合动力机构包括所述转盘内靠近所述离合滑槽侧设有的离合腔,所述离合腔靠近所述收纳槽侧设有用于出风的通孔,所述离合腔靠近所述离合滑槽的侧壁上嵌设有离合电机,所述离合电机的自带轴固定设有主动齿轮与风扇,所述风扇相较于所述主动齿轮靠近所述收纳槽,所述离合板靠近所述丝杆侧转动设有离合轴,所述离合轴贯穿所述离合滑槽伸到所述离合腔内,所述离合腔位于所述离合腔端固定设有离合齿轮,所述丝杆位于所述离合腔端固定设有从动齿轮,所述离合齿轮同时啮合所述从动齿轮与所述主动齿轮,所述离合腔关于所述离合电机对称的两侧内壁上设有通气腔,所述外壳内位于所述通气腔开口处设有环形的风腔,所述风腔靠近所述上釉腔侧设有通风孔。

[0014] 优选的,采用该陶瓷杯上釉的设备对陶瓷杯上釉的工艺包括以下步骤:

[0015] S1:固顶瓷杯,将瓷杯底部通过凸台粘接在凸台上,使杯口朝向内喷嘴;

[0016] S2:浸水,在瓷杯向内喷嘴运动时靠近丝杆的外喷嘴与内喷嘴向瓷杯的内外侧喷射水雾,使瓷杯浸水;

[0017] S3:喷釉,通过远离丝杆的外喷嘴与内喷嘴向瓷杯的内外侧喷射釉料;

[0018] S4:风干,通过风扇产生的风对瓷杯上的釉料风干冷却;

[0019] S5:清洗复位,支撑板复位时通过水管对外喷嘴与内喷嘴进行清洗;

[0020] S6:磨底,通过打磨纸对瓷杯底部边缘的釉渣进行轻打磨。

[0021] 有益效果:通过喷射水雾可以更好的时瓷杯吸收水分,且不会产生滑动的水珠,喷釉可以更好的时瓷杯表面挂釉,使使釉面不容易被烤裂,且还可以防止产生滑动的釉珠。

[0022] 通过凸台的粘性连接,可以使瓷杯外壁全部进行上釉处理,不用担心夹痕。

[0023] 打磨电机通过打磨齿轮带动转盘与打磨纸转动,使打磨纸对瓷杯底进行轻打磨,使瓷杯底的釉料打磨干净。

附图说明

[0024] 图1为本发明外观示意图；

[0025] 图2为本发明结构实施示意图；

[0026] 图3为图2中A-A方向示意图；

[0027] 图4为图2中B处放大示意图；

[0028] 图5为图2中C处放大示意图；

[0029] 图6为图2中D处放大示意图；

[0030] 图7为图4中E-E方向示意图。

[0031] 图中,外壳10;转杆槽11;滑槽12;机关开关弹簧13;转杆14;收缩槽15;电磁支撑杆16;转盘17;通气腔18;收纳槽19;釉料箱20;离合滑槽21;风腔22;外喷釉杆23;外喷嘴24;外釉管25;顶板26;内喷嘴27;内釉管28;支撑柱29;支撑板31;丝杆32;水管33;离合腔34;离合电机35;离合轴36;上釉腔37;离合板38;凸台39;转盘40;打磨纸41;打磨电机42;打磨齿轮43;转动腔44;从动齿轮45;离合齿轮46;主动齿轮47;风扇48;推釉板49;釉板弹簧50;水箱51;推水板52;水板弹簧53;机关槽54;第一电磁阀55;第二电磁阀56;磨底固定机构90;上釉机构91;离合触发机构92;离合动力机构93。

具体实施方式

[0032] 以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。

[0033] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“内”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0034] 结合图2,一种陶瓷杯上釉的工艺及其设备,该陶瓷杯上釉的工艺采用如下陶瓷杯上釉的设备配合完成,该陶瓷杯上釉的设备,包括外壳10,外壳10内设有一侧开口的上釉腔37,上釉腔37远离开口的内壁上转动设有转盘17,,转盘17内设有一开口朝向上釉腔37的收纳槽19,收纳槽19内靠近上釉腔37侧设有上釉机构91,上釉腔37内远离上釉腔37侧设有离合动力机构93,外壳10内位于上釉腔37的外围设有磨底固定机构90,外壳10内远离上釉腔37侧设有离合触发机构92。

[0035] 进一步,结合图3,图5,磨底固定机构90包括外壳10内环形均匀设置的四个开口朝向上釉腔37开口方向的收缩槽15,每个收缩槽15内都滑动设有电磁支撑杆16,每个电磁支撑杆16靠近上釉腔37开口端共同固定设有一个顶板26,顶板26靠近上釉腔37侧的中心位置固定设有凸台39,凸台39上转动设有转盘40,转盘40远离顶板26端固定设有打磨纸41,凸台39内靠近转盘40内圈的一侧设有开口朝向转盘40的转动腔44,转动腔44的内壁上嵌设有打磨电机42,打磨电机42的自带轴上固定设有打磨齿轮43,打磨齿轮43与转动腔44内圈内核连接。

[0036] 进一步,结合图2,图4,图7,离合触发机构92包括外壳10远离顶板26侧的中心位置设有的离合滑槽21,离合滑槽21内滑动设有离合板38,外壳10位于离合滑槽21处绕离合滑

槽21对应四个收缩槽15设有四个转杆槽11,每个收缩槽15的内壁上都设有开口朝向收缩槽15的滑槽12,每个滑槽12内都滑动设有机关槽54,每个机关槽54通过机关开关弹簧13连接在滑槽12的内壁上,每个滑槽12靠近对应转杆槽11侧都连通转杆槽11,每个机关槽54都通过可转动的转杆14铰接在离合板38上,每个转杆14靠近离合滑槽21侧都通过铰链连接在对应转杆槽11的侧壁上。

[0037] 进一步,结合图2,图6,上釉机构91包括收纳槽19远离上釉腔37的内壁上转动设有丝杆32,丝杆32上靠近收纳槽19的开口处螺纹设有支撑板31,支撑板31上设有通气孔,支撑板31上的中心位置固定设有支撑柱29,支撑板31关于支撑柱29两侧对称固定设有两个外喷釉杆23,收纳槽19的内壁上远离丝杆32的固定设有釉料箱20,收纳槽19的内壁上靠近丝杆32处固定设有两个水箱51。

[0038] 进一步,结合图2,图6,上釉机构91还包括支撑柱29靠近顶板26端固定设有的内喷嘴27,两个外喷釉杆23靠近顶板26端都朝向内喷嘴27固定设有的外喷嘴24,远离丝杆32的外喷嘴24通过外釉管25穿过外喷釉杆23连接到釉料箱20内,内喷嘴27通过内釉管28穿过支撑柱29连接在釉料箱20内,靠近丝杆32的外喷嘴24与内喷嘴27通过水管33分别穿过外喷釉杆23与支撑柱29连接在水箱51内,水箱51内远离丝杆32侧滑动设有推水板52,推水板52通过水板弹簧53连接在水箱51远离丝杆32的侧壁上,每个釉料箱20靠近水箱51侧都滑动设有推釉板49,每个推釉板49都通过釉板弹簧50连接在对应釉料箱20靠近水箱51的侧壁上,水管33与内喷嘴27的连接处与水管33与外喷嘴24的连接处固定设有第一电磁阀55,内釉管28与内喷嘴27的连接处与外釉管25与外喷嘴24的连接处固定设有第二电磁阀56。

[0039] 进一步,结合图2,图6,离合动力机构93包括转盘17内靠近离合滑槽21侧设有的离合腔34,离合腔34靠近收纳槽19侧设有用于出风的通孔,离合腔34靠近离合滑槽21的侧壁上嵌设有离合电机35,离合电机35的自带轴固定设有主动齿轮47与风扇48,风扇48相较于主动齿轮47靠近收纳槽19,离合板38靠近丝杆32侧转动设有离合轴36,离合轴36贯穿离合滑槽21伸到离合腔34内,离合腔34位于离合腔34端固定设有离合齿轮46,丝杆32位于离合腔34端固定设有从动齿轮45,离合齿轮46同时啮合从动齿轮45与主动齿轮47,离合腔34关于离合电机35对称的两侧内壁上设有通气腔18,外壳10内位于通气腔18开口处设有环形的风腔22,风腔22靠近上釉腔37侧设有通风孔。

[0040] 进一步,采用该陶瓷杯上釉的设备对陶瓷杯上釉的工艺包括以下步骤:

[0041] S1:固顶瓷杯,将瓷杯底部通过凸台39粘接在凸台39上,使杯口朝向内喷嘴27;

[0042] S2:浸水,在瓷杯朝内喷嘴27运动时靠近丝杆32的外喷嘴24与内喷嘴27向瓷杯的内外侧喷射水雾,使瓷杯浸水;

[0043] S3:喷釉,通过远离丝杆32的外喷嘴24与内喷嘴27向瓷杯的内外侧喷射釉料;

[0044] S4:风干,通过风扇48产生的风对瓷杯上的釉料风干冷却;

[0045] S5:清洗复位,支撑板31复位时通过水管33对外喷嘴24与内喷嘴27进行清洗;

[0046] S6:磨底,通过打磨纸41对瓷杯底部边缘的釉渣进行轻打磨。

[0047] 工作原理:使电磁支撑杆16带动顶板26从收缩槽15内滑出,机关开关弹簧13顶动机关槽54,使机关槽54通过转杆14带动离合板38向远离收纳槽19的方向滑动,使离合轴36带动离合齿轮46滑动,使离合齿轮46同时与从动齿轮45、主动齿轮47断开连接,将瓷杯粘接在凸台39上,通过凸台39的粘性连接,可以使瓷杯外壁全部进行上釉处理,不用担心夹痕,

再使电磁支撑杆16缩回收缩槽15内,在收缩槽15缩回的同时启动离合电机35,使离合电机35带动转盘17转动,转盘17通过支撑板31带动外喷釉杆23与内喷嘴27转动,在转盘17转动的同时由于离心力带动推水板52与推釉板49滑动,使推水板52压动水箱51内的水通过水管33与第一电磁阀55从内喷嘴27化成水雾喷射在瓷杯内壁,通过水管33与第一电磁阀55从外喷嘴24处化成水雾喷射在瓷杯外壁,对瓷杯浸水处理,通过喷射水雾可以更好的时瓷杯吸收水分,且不会产生滑动的水珠,顶板26完全将上釉腔37盖住后电磁支撑杆16按下机关槽54,机关槽54通过转杆14带动离合板38滑动,使离合轴36带动离合齿轮46与从动齿轮45、主动齿轮47啮合连接,使离合电机35通过离合齿轮46与从动齿轮45带动丝杆32转动,通过丝杆32转动带动支撑板31向靠近离合滑槽21方向滑动,使外喷嘴24与内喷嘴27向瓷杯口方向滑动,同时推釉板49通过1的离心力滑动,使釉料箱20内的釉料通过内釉管28与外釉管25通过第二电磁阀56与内喷嘴27、外喷嘴24向瓷杯的内外壁进行喷釉处理,喷釉可以更好的时瓷杯表面挂釉,使使釉面不容易被烤裂,且还可以防止产生滑动的釉珠,离合腔34转动的同时风扇48产生风,通过离合滑槽21的通孔与支撑板31的通孔作用到瓷杯内壁,通过通气腔18与风腔22作用到瓷杯外壁,风扇48产生的风不仅可以使瓷杯上的釉快速风干,还可以有效的对离合电机35之间传动产生的热量进行驱散,待支撑板31循环完成一侧来回瓷杯喷完釉的同时关闭第二电磁阀56,将电磁支撑杆16滑出,带动顶板26运动,将瓷杯从上釉腔37内带出,同时启动打磨电机42,使打磨齿轮43带动转盘40与打磨纸41转动,使打磨纸41对瓷杯底进行轻打磨,使瓷杯底的釉料打磨干净。。

[0048] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利保护范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

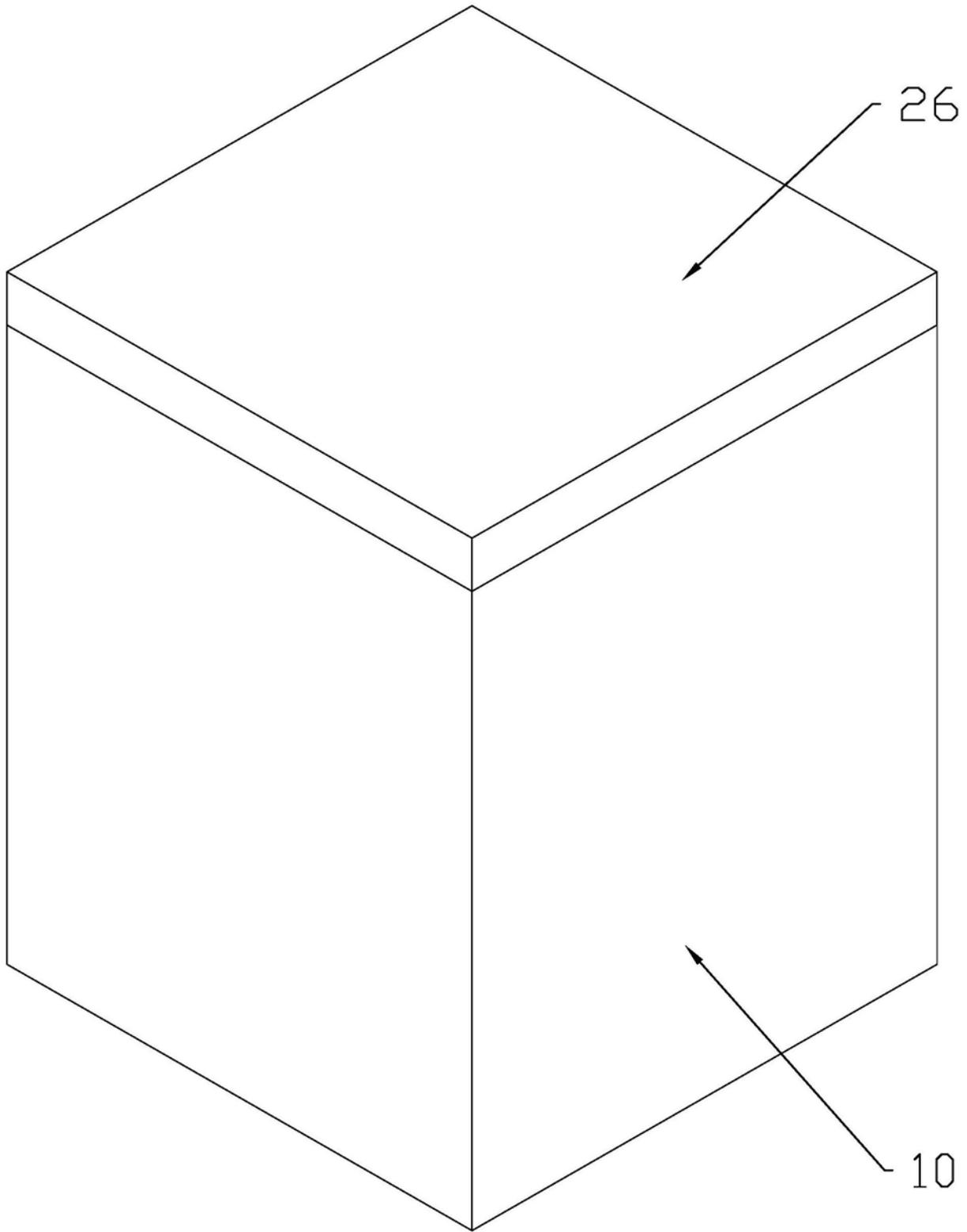


图1

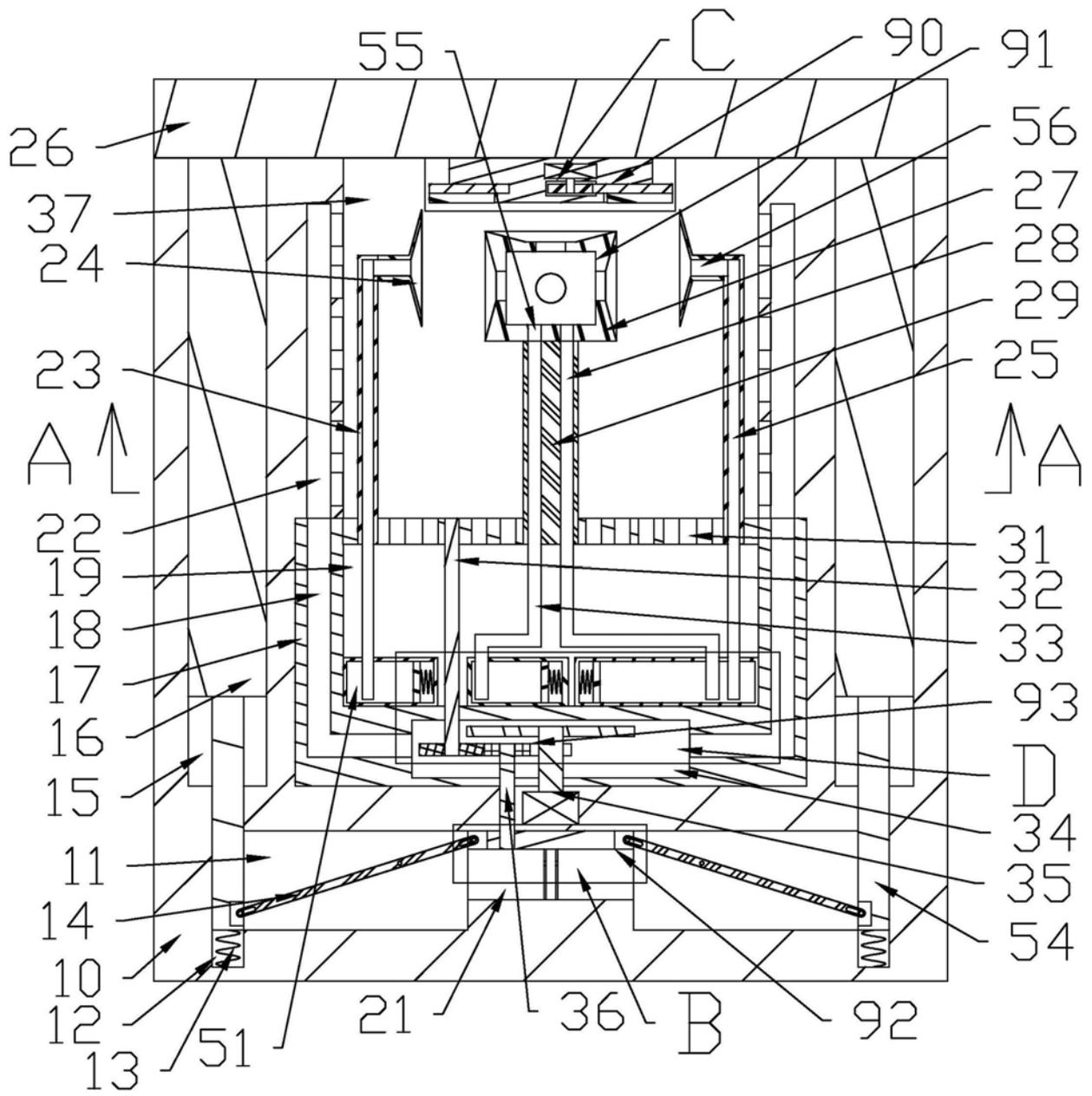


图2

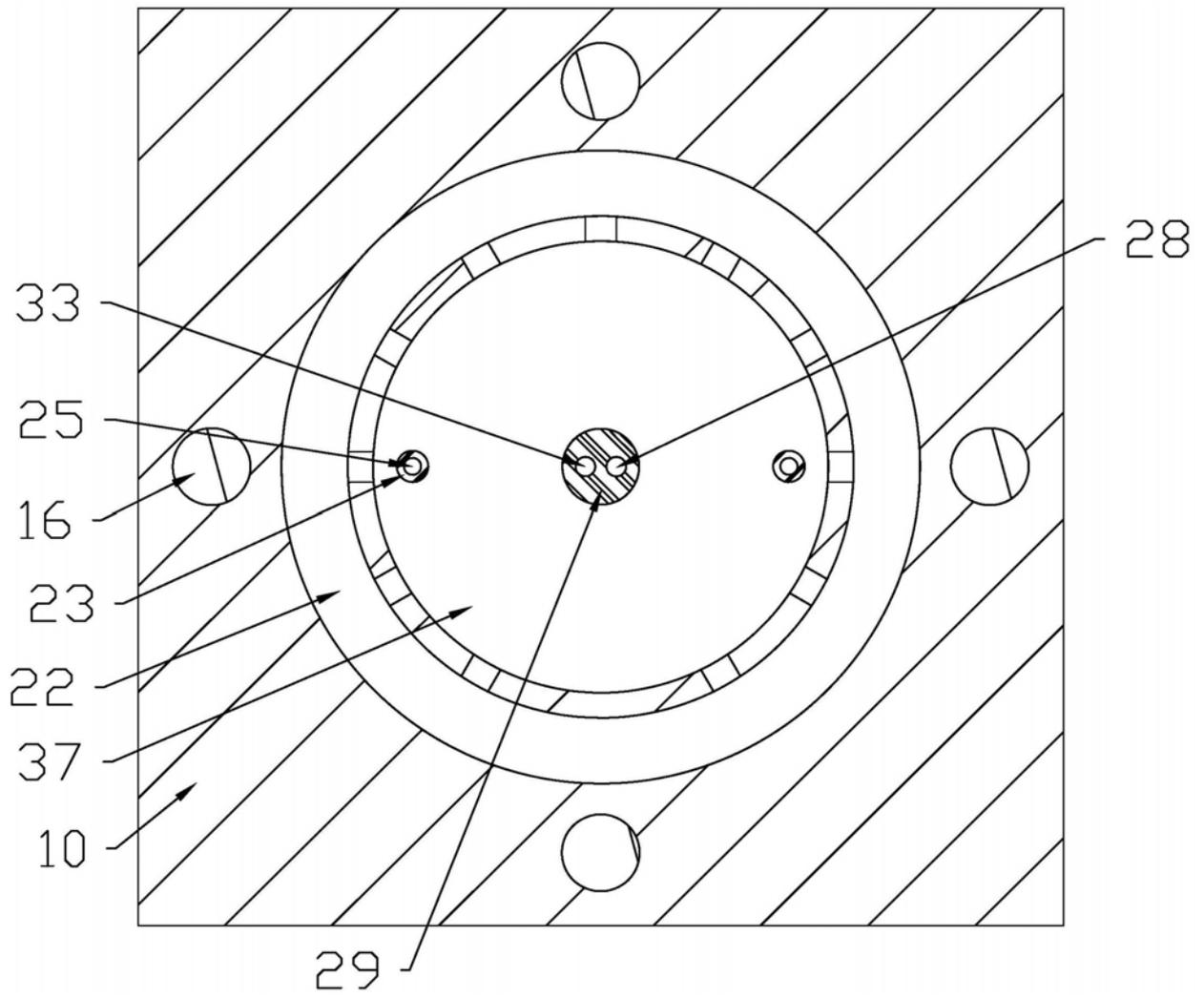


图3

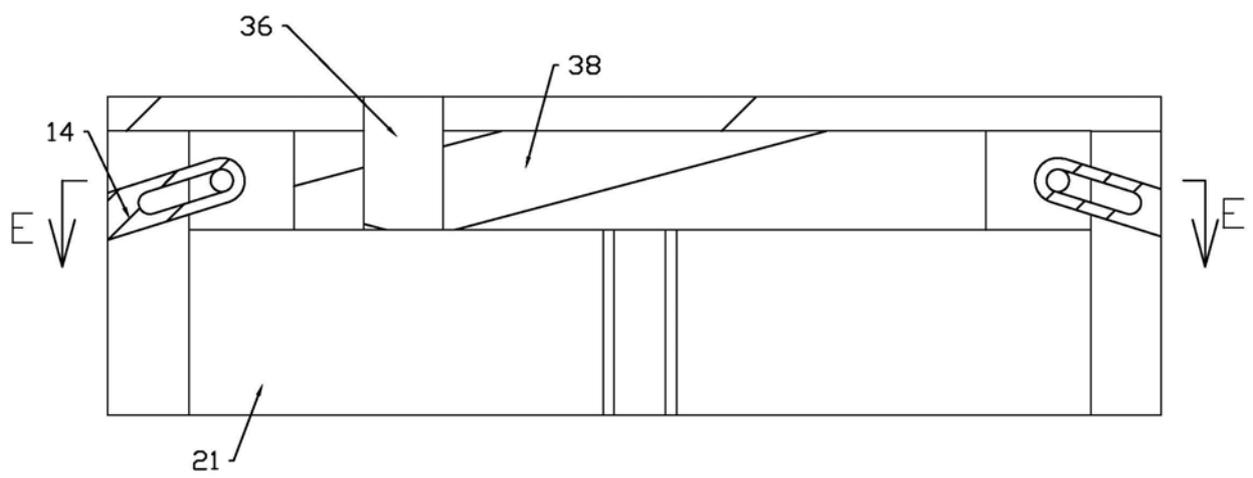


图4

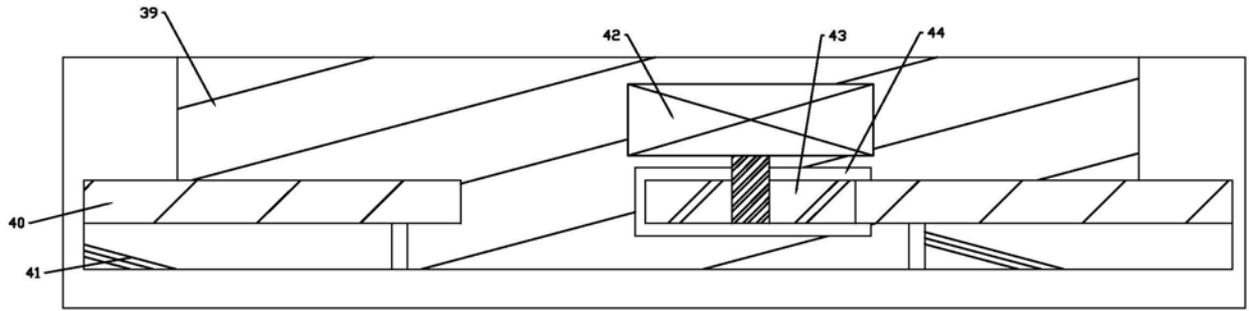


图5

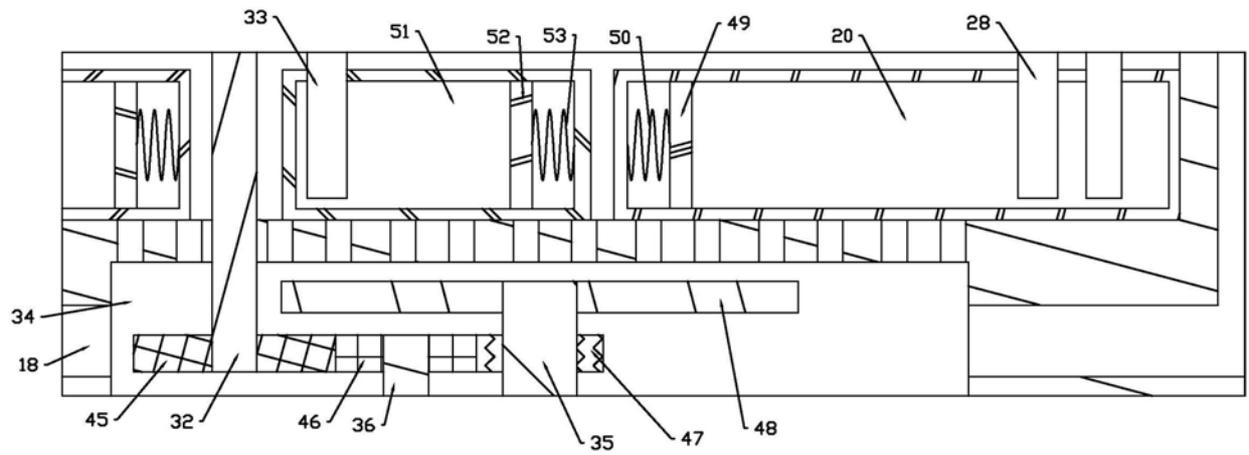


图6

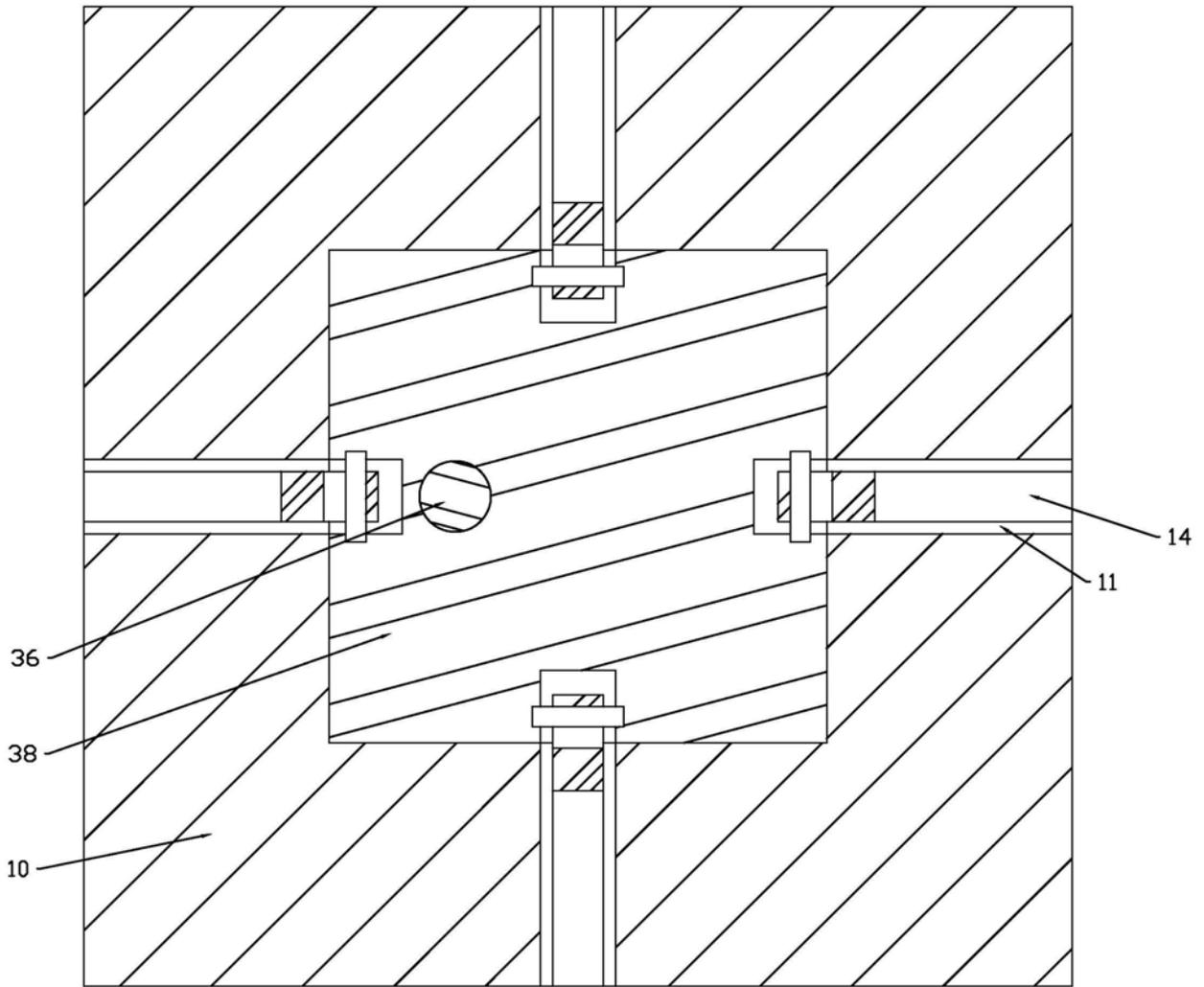


图7